

第2回

EUV-FEL WORKSHOP

ワークショップ

加速器科学による産業革新

～さらなる半導体産業の発展に向けて～

参加費
無料
定員 120名

開催

2017 **12.12** Tue 10:00-17:00

招待講演

"EUV industrialization for HVM and future outlook"

ASML, Strategic Marketing, Director **Michael Lercel 氏**

「SACLAでのX線レーザープラズマ増幅実験と

EUV-FELへの応用可能性」

理化学研究所 放射光科学総合研究センター長 **石川哲也 氏**

「EUV微細加工技術に向けたSXFELと

物質・材料の相互作用に関する研究」

量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 グループリーダー **錦野将元 氏**

web 申込み先



申込み締切 **12月6日(水)まで**

http://pfwww.kek.jp/PEARL/EUV-FEL_Workshop2/index.html

開催場所



東京 御茶ノ水

中央大学駿河台記念館2階

<http://www.chuo-u.ac.jp/access/surugadai/>

お問い合わせ

高エネルギー加速器研究機構

研究支援戦略推進部 大学・産業連携推進室

TEL.029-879-6239

主催：EUV-FEL 光源産業化研究会、高エネルギー加速器研究機構

共催：産業技術総合研究所、東京大学

後援：TIA

